

M-centar u $4H$ -SiC ozračenom niskoenergetskim elektronima

Eva Jelavić

Mentorica: dr. sc. Ivana Capan, Institut Ruđer Bošković

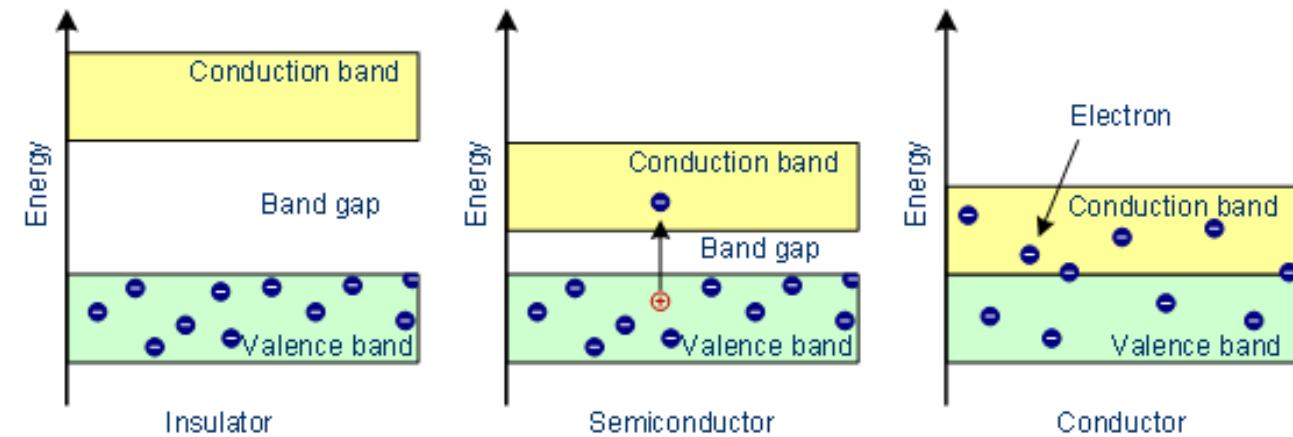
Kolegij: Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, siječanj 2023.

Silicijev karbid

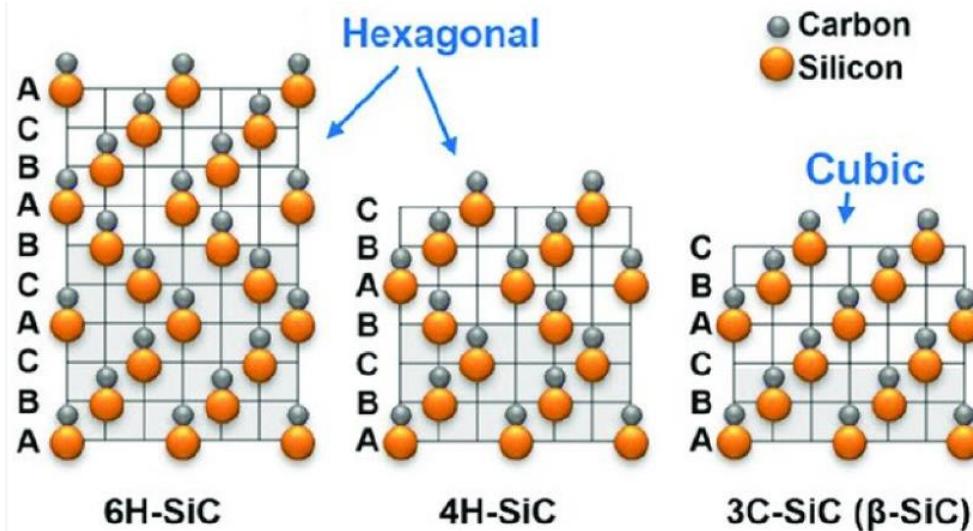
- Poluvodički materijal
- Široki energetski procjep
- Visoka termička vodljivost
- Otpornost na koroziju
- Jednak broj atoma Si i C
- Vezanje hibridnim sp^3 orbitalama



Prikaz energetskih procjepa kod izolatora, poluvodiča i vodiča.
Preuzeto iz [1]

Silicijev karbid

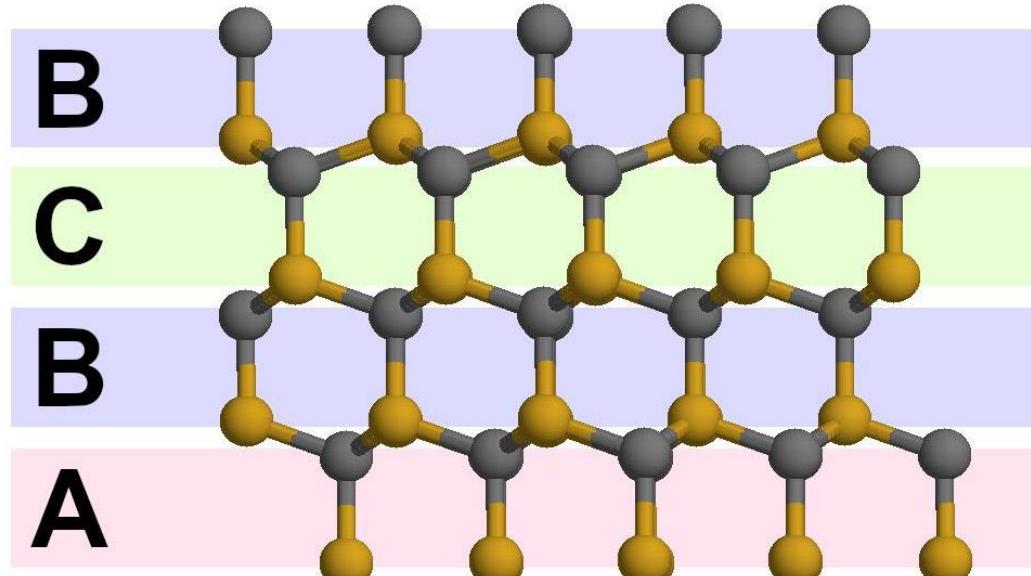
- Polimorfan materijal – preko 250 polimorfnih supstancija
- Neki politipovi: $2H\text{-SiC}$, $3C\text{-SiC}$ $4H\text{-SiC}$, $6H\text{-SiC}$
- Korišteni u izradi elektroničkih komponenti u sustavima za napajanje električnih vozila i detektorima koji imaju visok omjer šuma i signala



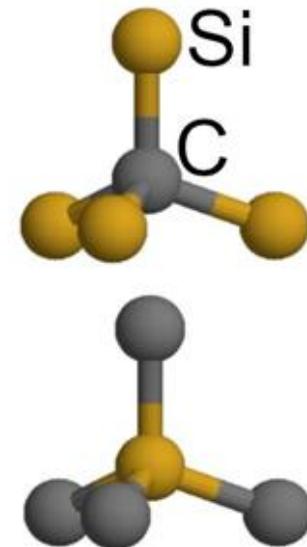
Prikaz struktura politipova silicijevog karbida. Preuzeto iz [2]

$4H$ -SiC

- Slojevi se slažu periodički
- Ponavlja se uzorak od četiri sloja
- Kristalizacija u heksagonskoj ćeliji



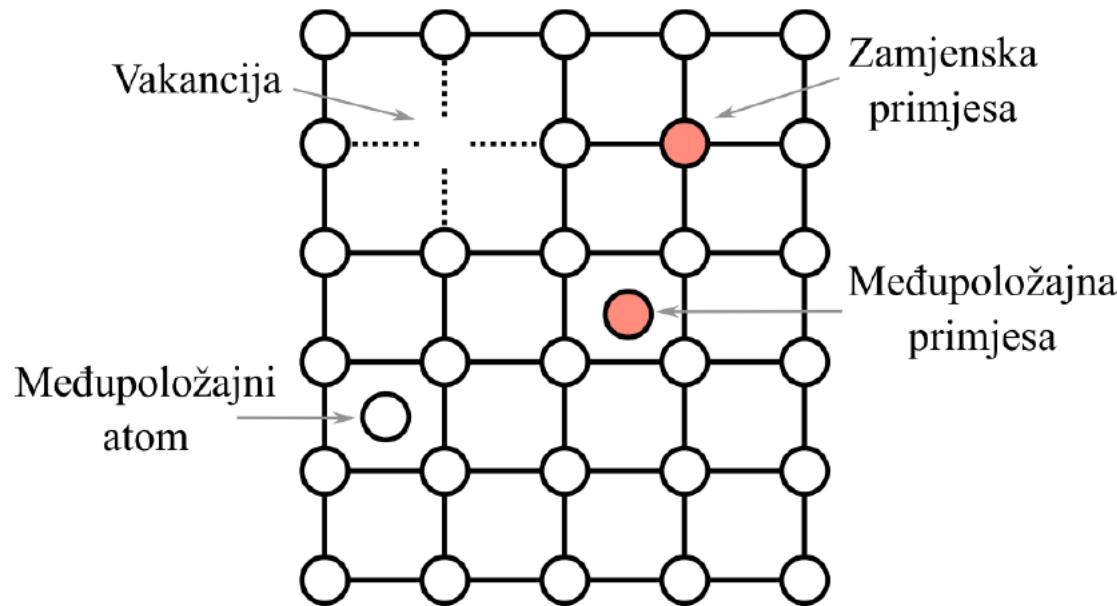
Shematski prikaz kristalne strukture $4H$ politipa SiC s označenim položajima Si-C ravnina. Preuzeto iz [3]



Shematski prikaz veze ugljikovog atoma sa susjednim atomima silicija. Preuzeto iz [3]

Električki aktivni defekti u 4H-SiC

- Točkasti defekti:
 - a) vakancije
 - b) međupoložajni atom
 - c) zamjenska primjesa
 - d) međupoložajna primjesa
- Dvodimenzionalni defekti:
 - a) dislokacija
 - b) pogreška u redoslijedu ravnina



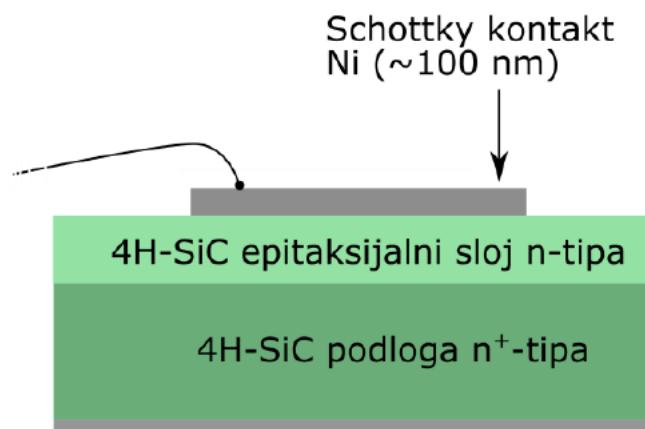
Shematski prikaz točkastih defekata u kristalnoj strukturi.
Preuzeto iz [3]

Električki aktivni defekti u 4H-SiC

- Defekti se dijele na donore i akceptore
- Donori predaju elektrone vodljivoj vrpcu ili uhvate šupljinu
- Akceptor predaju šupljine ili uhvate elektron
- Vjerojatnost uhvata:
 - a) elektrona: $C_n = \sigma_n v_{th,n} n$
 - b) šupljine: $C_p = \sigma_p v_{th,p} p$

Karakterizacija diode

- Shottky dioda
- Spoj metala i poluvodiča
- Uz površinu metala nalaze se elektroni
- Uz površinu poluvodiča nalaze se pozitivni naboji
- Stvara se područje osiromašenja unutar poluvodiča



Shematski prikaz 4H-SiC Schottky diode.
Preuzeto iz [3]

Karakterizacija diode

- Strujno naponska karakteristika

$$I(U) = I_s \left[e^{\frac{q(U - IR_s)}{nk_B T}} - 1 \right]$$

- I_s je struja saturacije
- n je faktor idealnosti
- R_s je serijski otpor spoja

Karakterizacija diode

- Kapacitivno naponska karakteristika

$$C(U) = A \sqrt{\frac{q\epsilon\epsilon_0}{2} \frac{N_D^+ - N_A^-}{U_{Bi} - U - \frac{k_B T}{q}}}$$

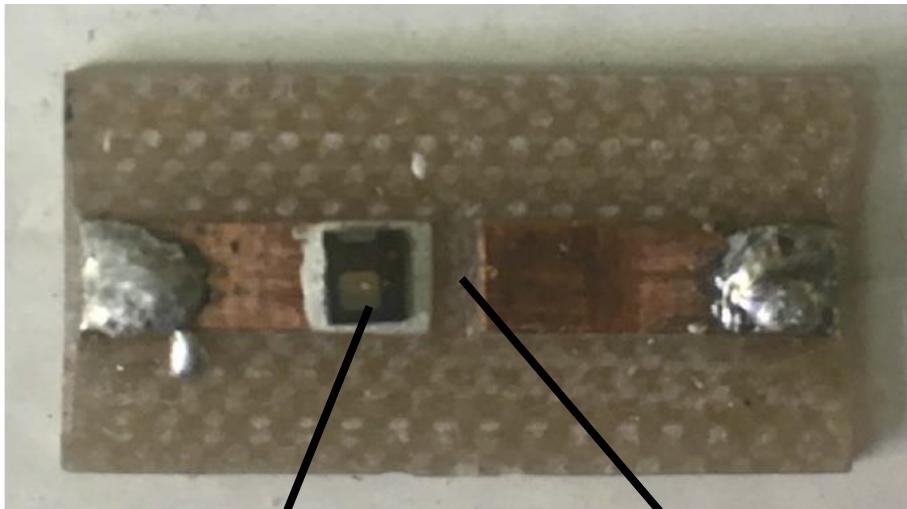
$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{q\epsilon\epsilon_0 A^2} \frac{U_{Bi} - U - \frac{k_B T}{q}}{N_D^+ - N_A^-}$$

Karakterizacija diode

- Tranzijentna spektroskopija dubokih nivoa
 - duboki nivoi su od vodljive ili valentne vrpce udaljeni za nekoliko vrijednosti $k_B T$
 - određuju se parametri dubokih nivoa vezani uz generaciju, rekombinaciju i zatočenje nosioca naboja
 - proučavaju se električki aktivni defekti
 - Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) služi za karakterizaciju zamki za većinske naboje

Eksperimentalna metoda

- U eksperimentu je korišten uzorak veličine 1 mm x 1 mm

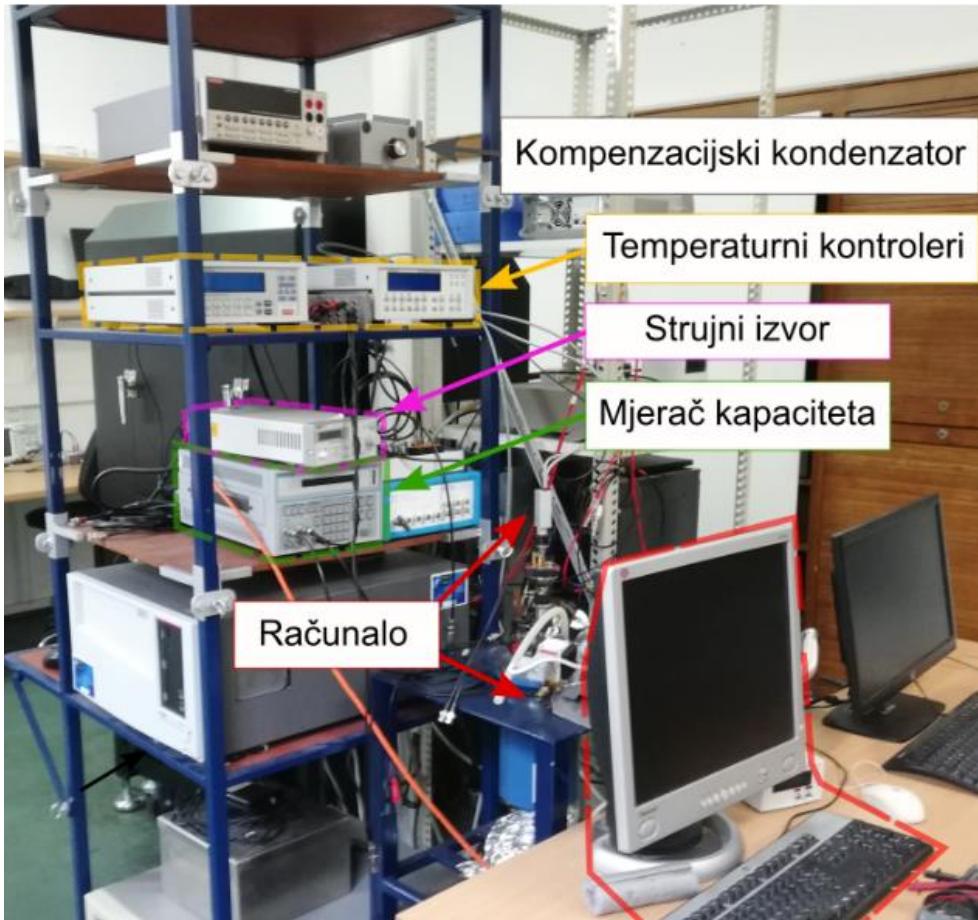


uzorak SiC

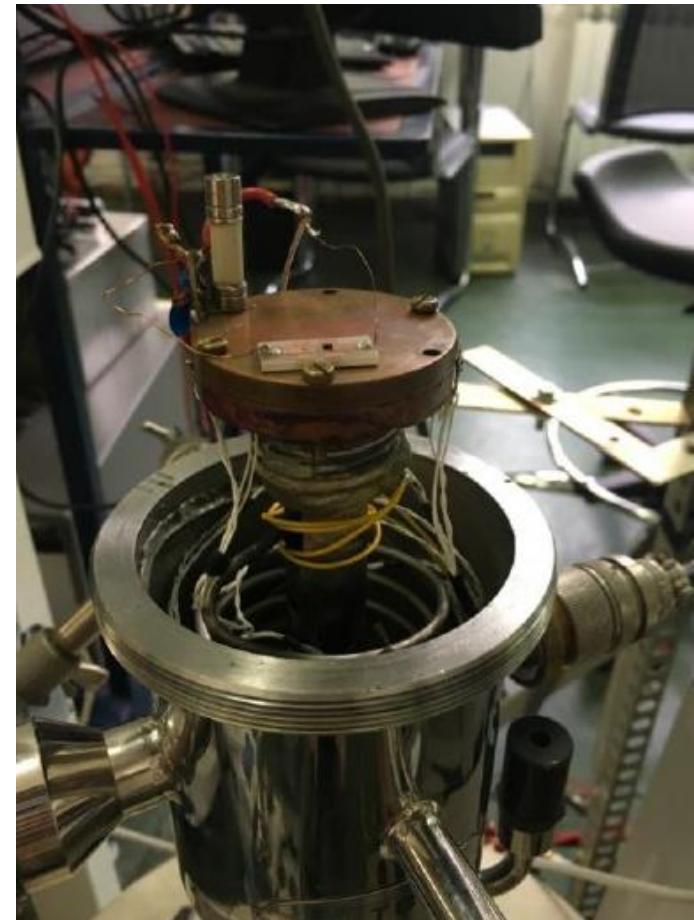
bond žica

Fotografija uzorka korištenog u eksperimentu.
Preuzeto iz [4]

Eksperimentalna metoda



Fotografija eksperimentalnog postava



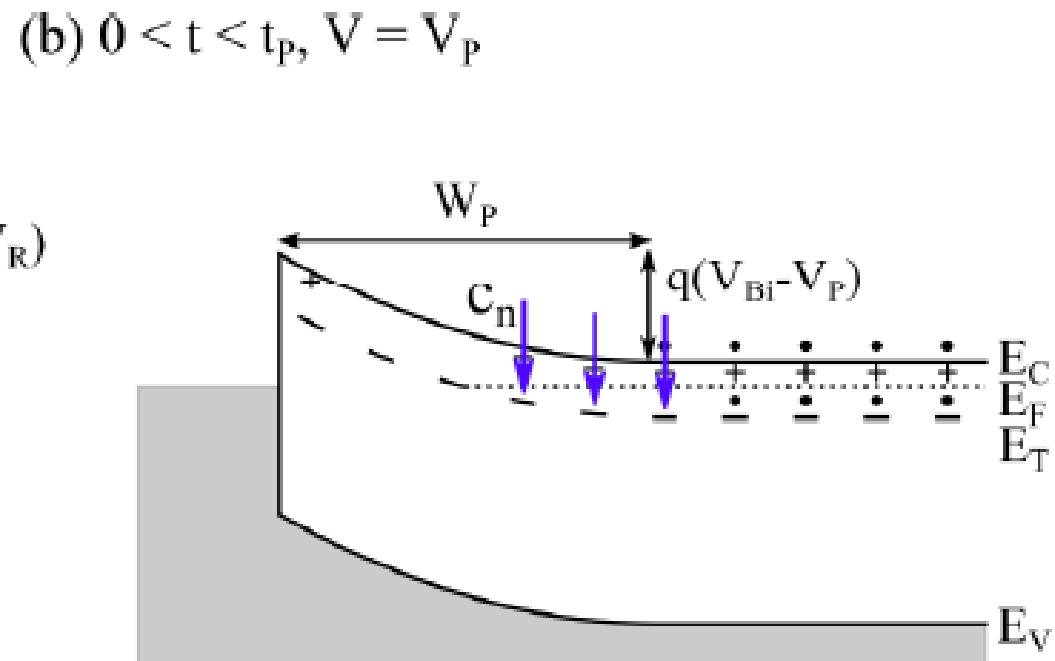
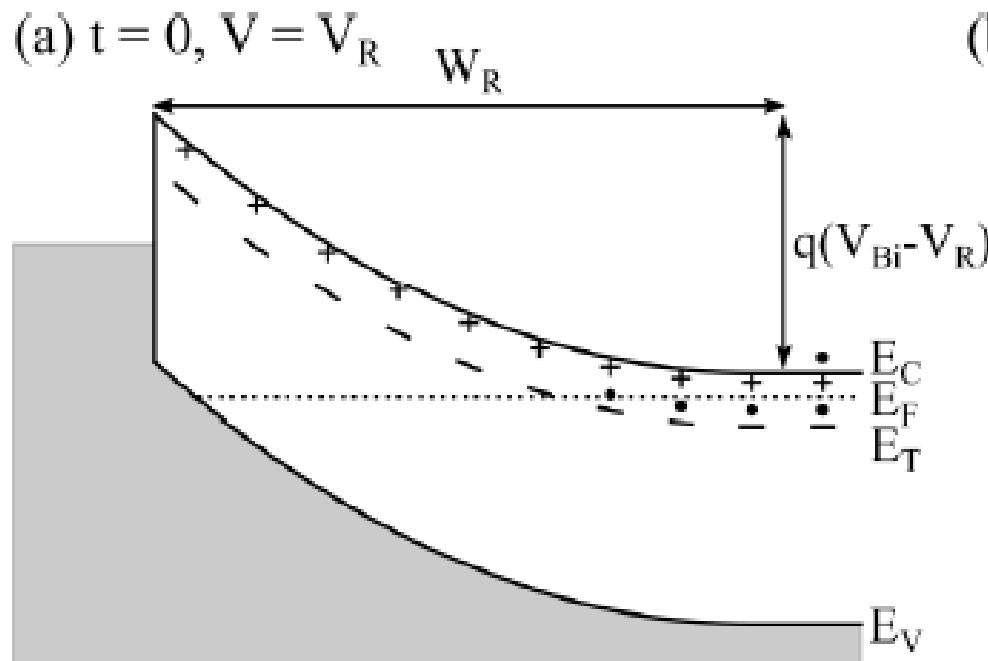
Fotografija uzorka u kriostatu

Eksperimentalna metoda

- Mjerenje ovisnosti struje o naponu i kapaciteta o naponu
 - za mjerenje ovisnosti struje o naponu primjenjuje se reverzni napon što znači da postoji samo protok elektrona s metala na poluvodič
 - iz ovisnosti struje o naponu dobivamo informaciju o struji saturacije i faktoru idealnosti
 - kapacitet se mjeri kao povećanje naboja unutar područja osiromašenja pri povećanju vanjskog napona
 - iz ovisnosti kapaciteta o naponu dobije se koncentracija nosioca naboja

Eksperimentalna metoda

- Tranzijentna spektroskopija dubokih nivoa

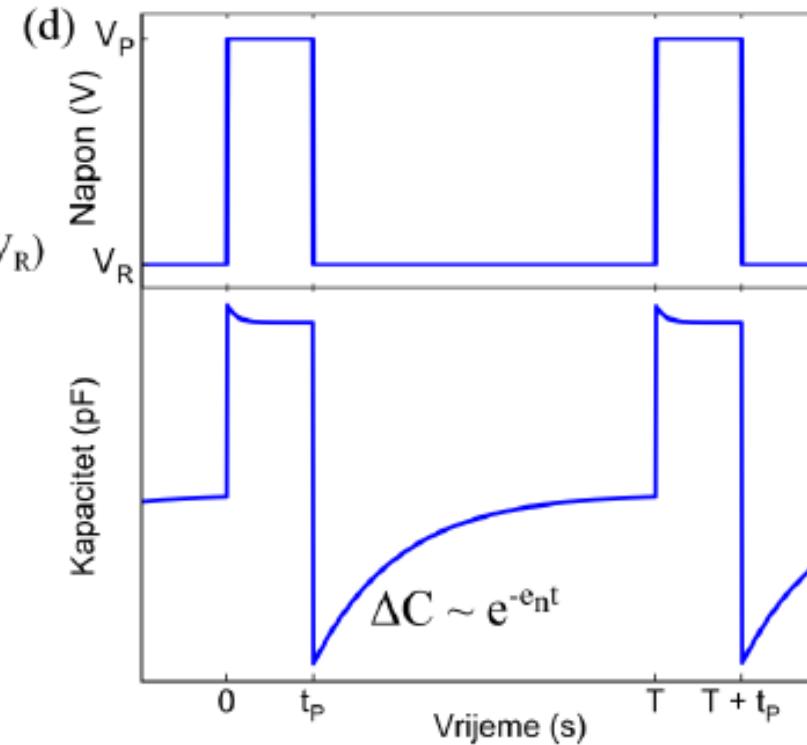
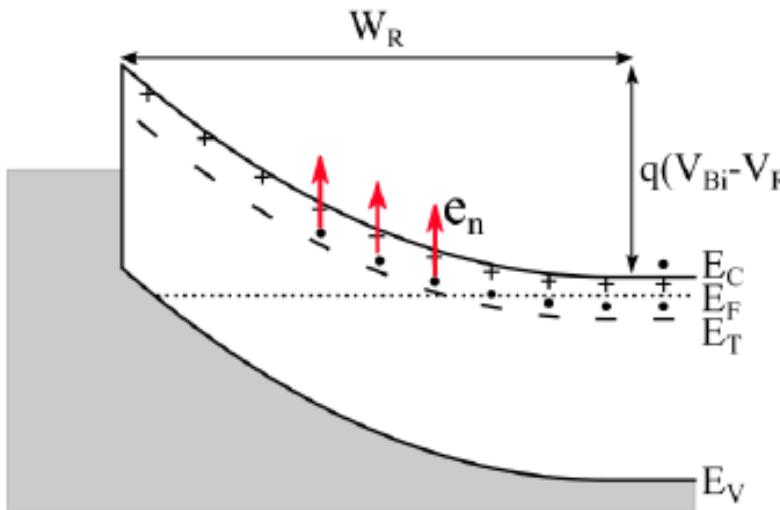


Preuzeto iz [4]

Eksperimentalna metoda

- Tranzijentna spektroskopija dubokih nivoa

(c) $t_p < t < T, V = V_R$



Preuzeto iz [4]

Rezultati mjerenja

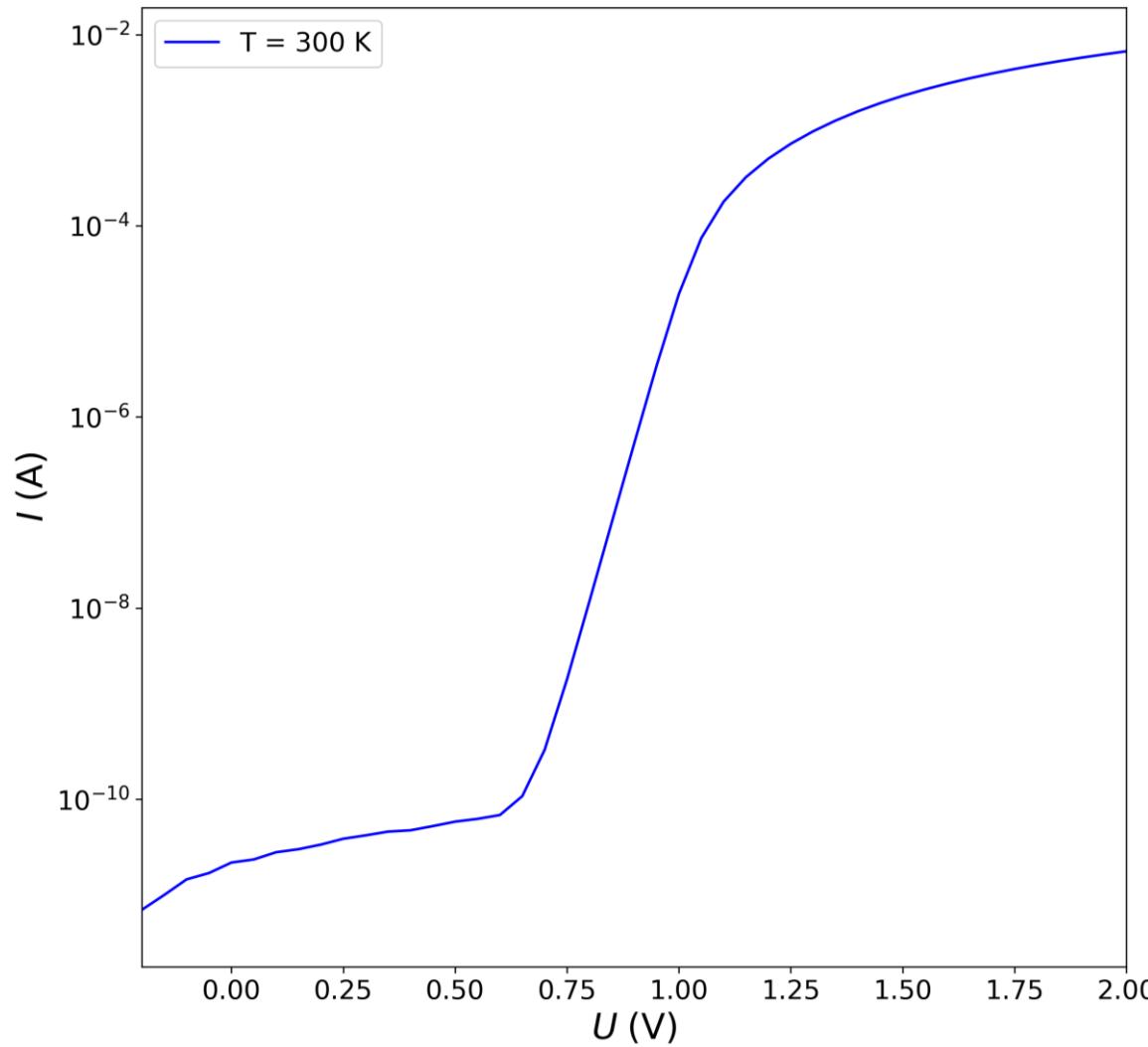
- Ovisnost struje o naponu

$$\ln(I) = \ln(I_s) + \frac{q}{nk_B T} U$$

The diagram illustrates the components of the equation. The term $\ln(I)$ is shown with arrows pointing to the variables I , q , and U . The term $\ln(I_s)$ is shown with an arrow pointing to the variable I_s . The term $\frac{q}{nk_B T}$ is shown with arrows pointing to the variables q , n , k_B , and T . The variable U is shown with an arrow pointing to it from the variable U .

- Iz nagiba pravca dobije se faktor idealnosti, a iz odsječka na y – osi struja saturacije

Rezultati mjerjenja



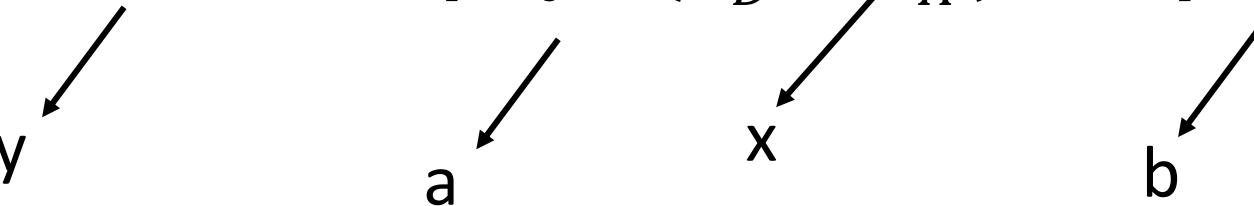
Graf ovisnosti struje o naponu
pri temperaturi od $T = 300 \text{ K}$

$$I_s = (3.9 \pm 1.9) \cdot 10^{-21} \text{ A}$$

$$n = (1.07 \pm 0.20)$$

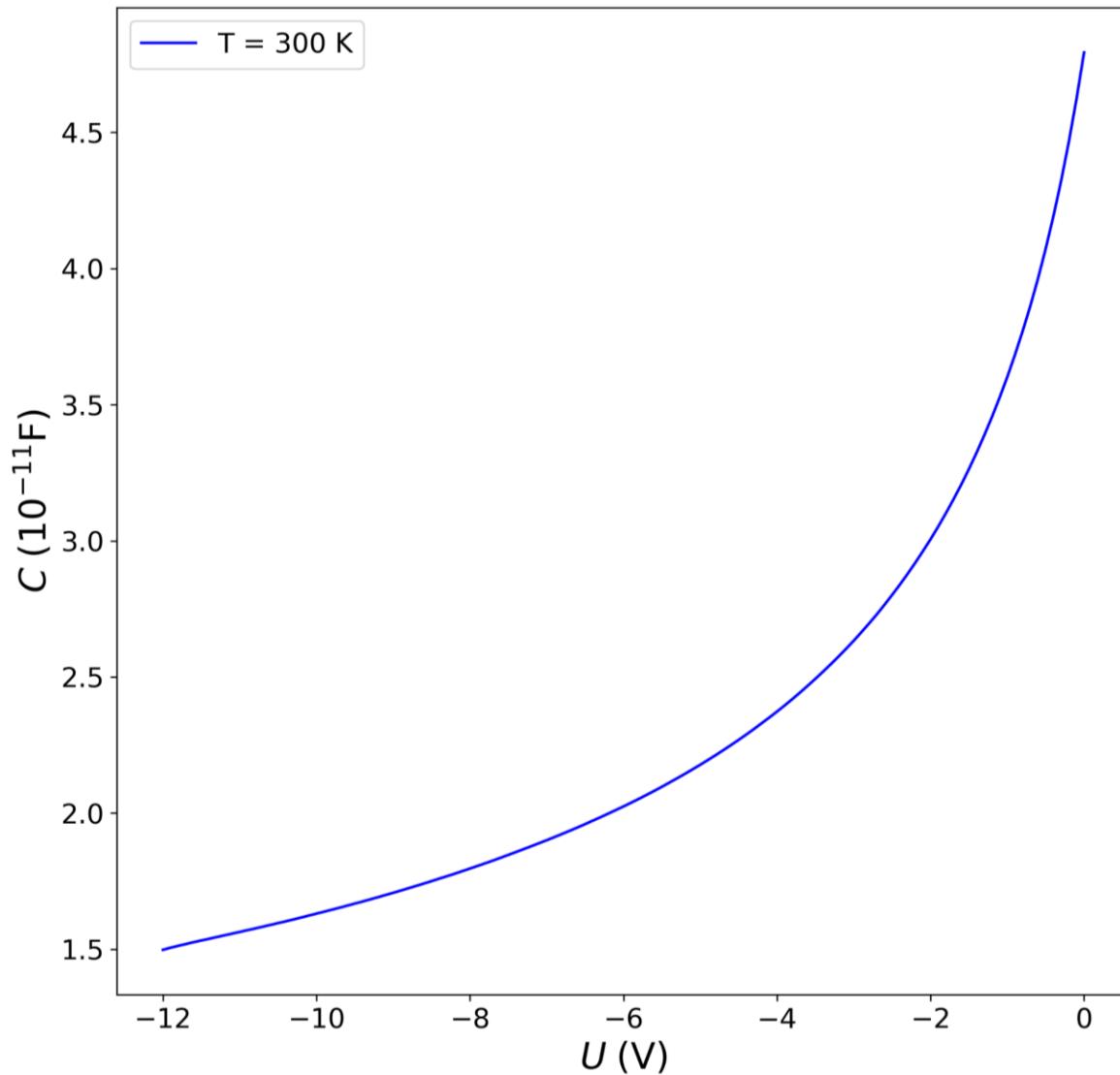
Rezultati mjerenja

- Ovisnost kapaciteta o naponu

$$\frac{1}{C^2} = \frac{-2}{q\epsilon\epsilon_0 A^2 (N_D^+ - N_A^-)} U + \frac{2 \left(U_{Bi} - \frac{k_B T}{q} \right)}{q\epsilon\epsilon_0 A^2 (N_D^+ - N_A^-)}$$


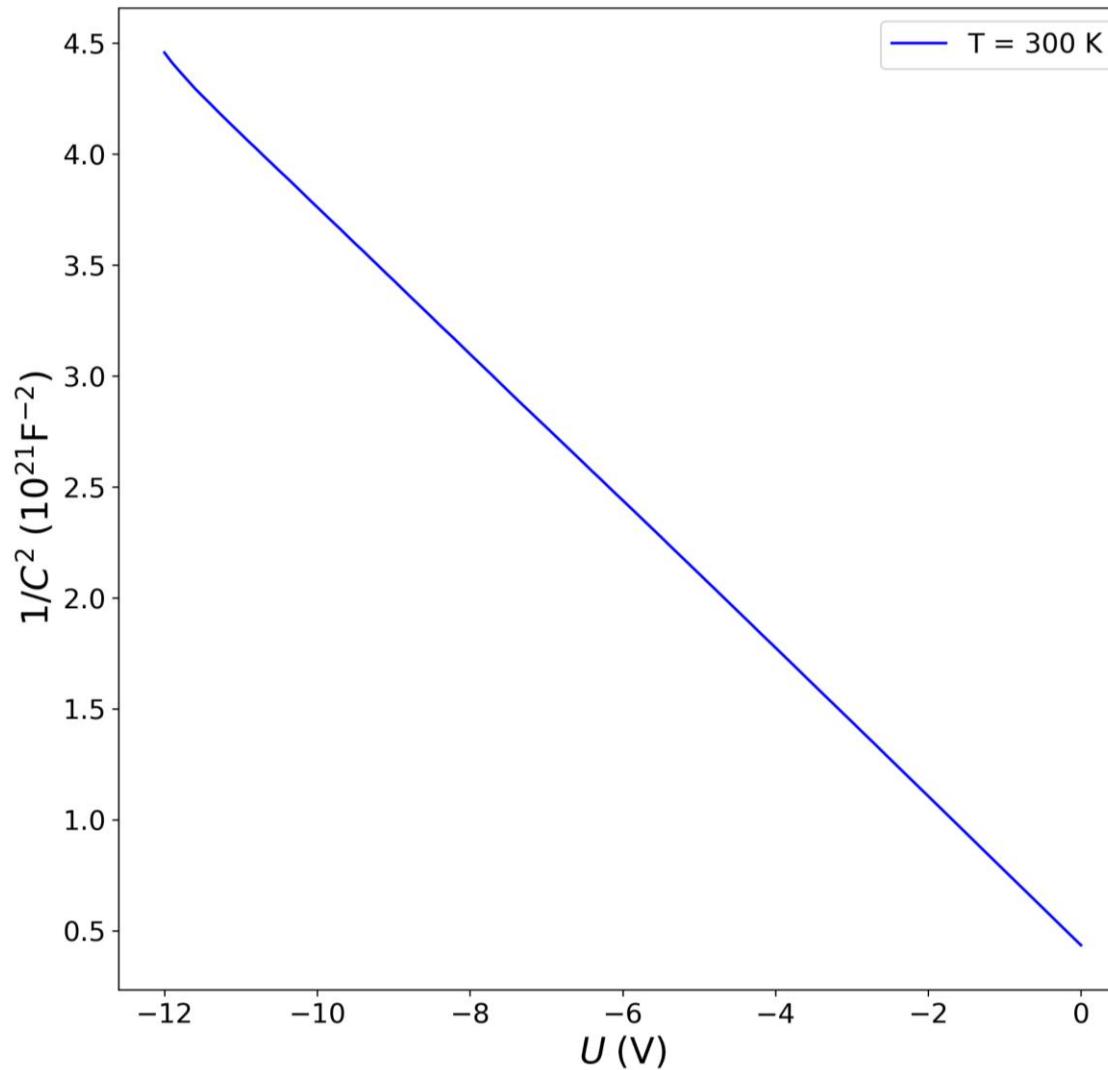
- Iz nagiba pravca odredi se koncentracija nosioca naboja

Rezultati mjerenja



Graf ovisnosti kapaciteta o naponu
pri temperaturi od $T = 300 \text{ K}$

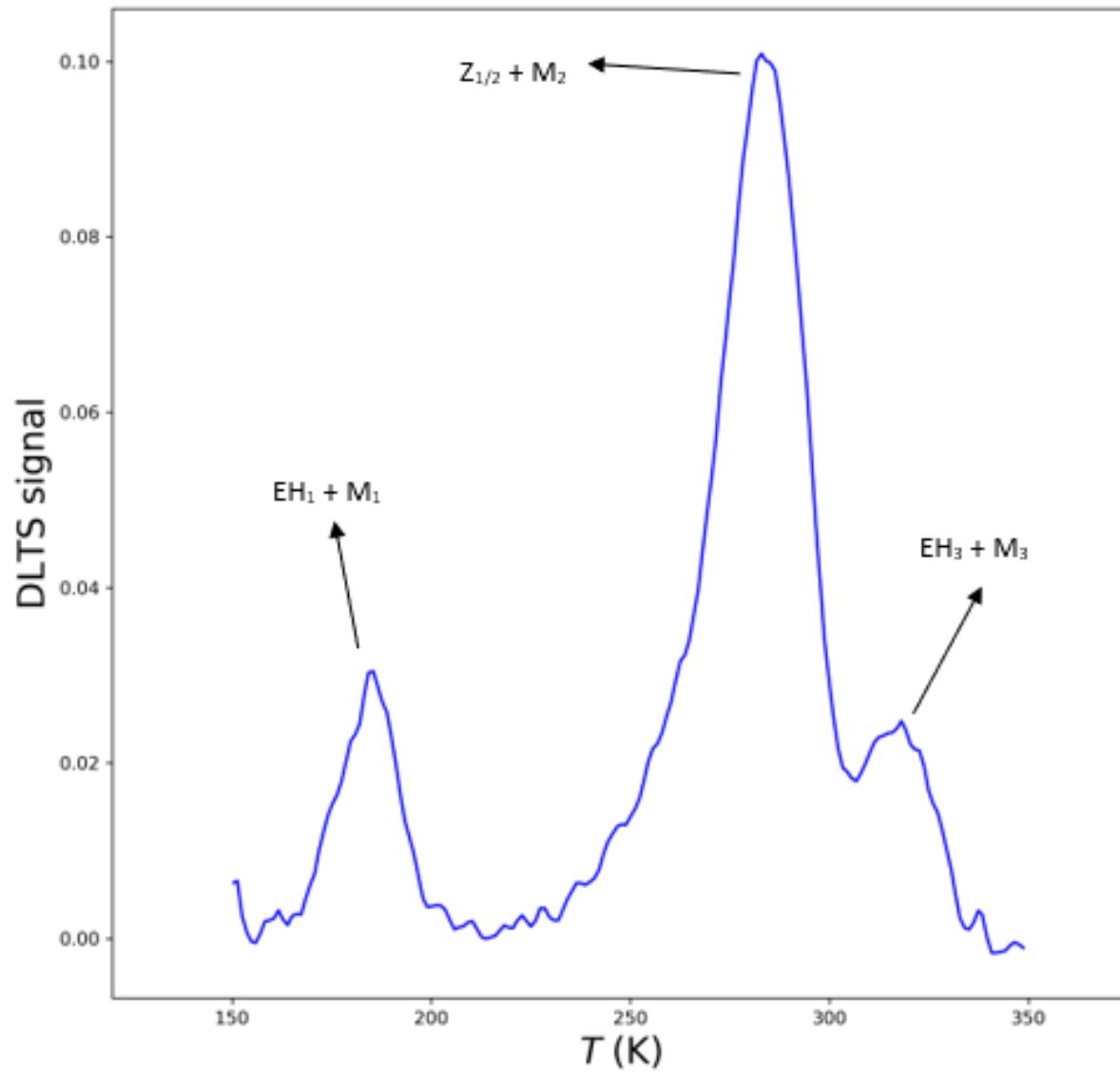
Rezultati mjerenja



Graf ovisnosti recipročne vrijednosti kvadrata kapaciteta o naponu pri temperaturi od $T = 300 \text{ K}$

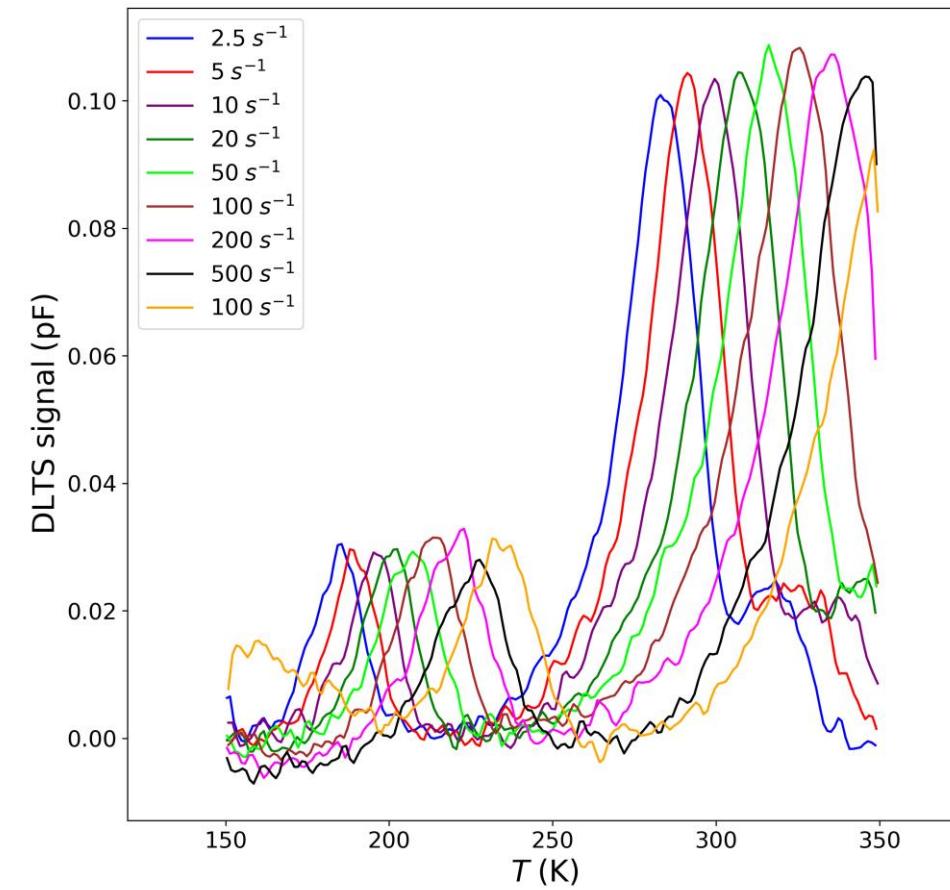
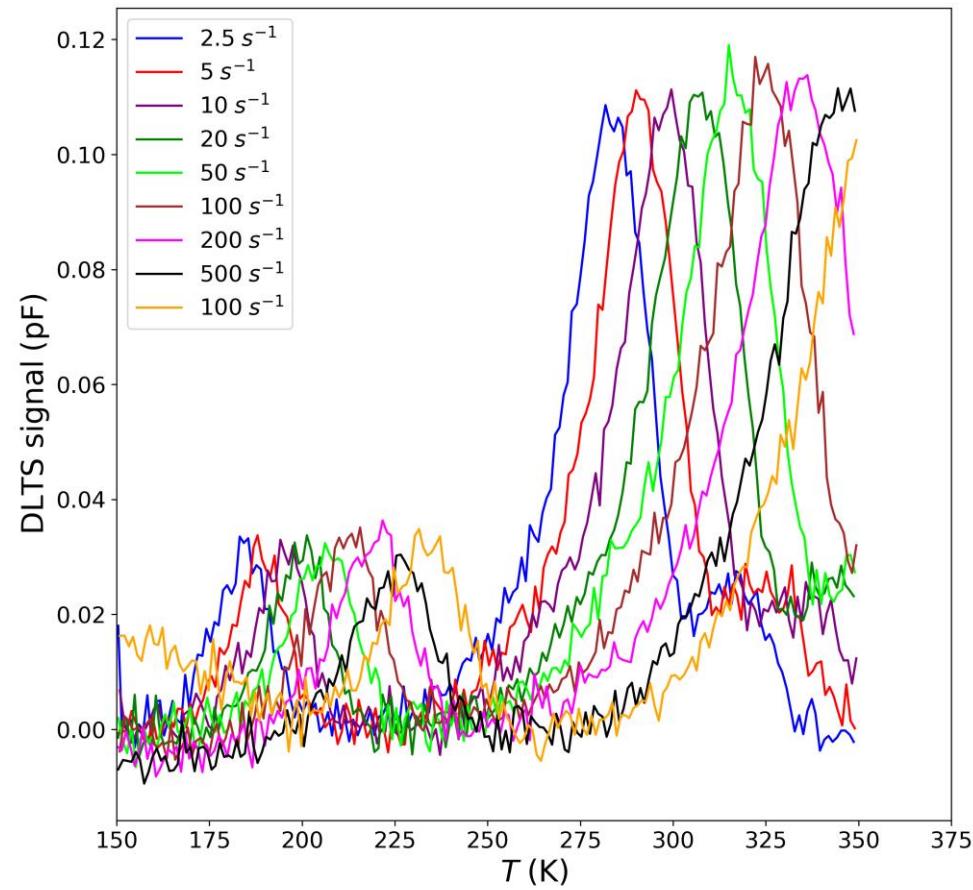
$$N = (4.2 \pm 0.1) \cdot 10^{15} \text{ m}^{-3}$$

Rezultati mjerenja



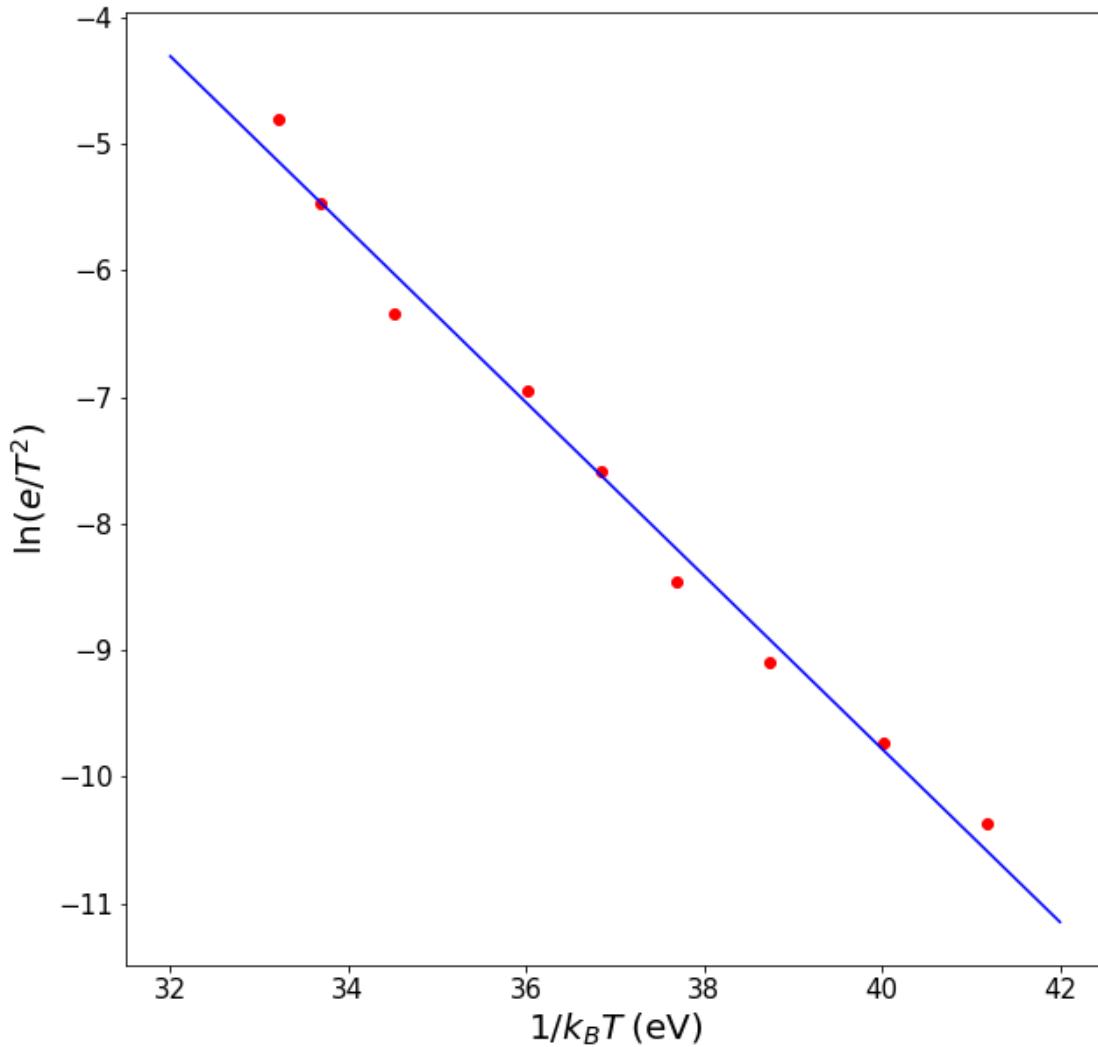
Graf DLTS signala za jedan emisijski prozor

Rezultati mjerenja



Grafovi DLTS signala u ovisnosti u temperaturi

Rezultati mjerenja



Arrhenius graf

$$E_a = (0.63 \pm 0.03) \text{ eV}$$

Zaključak

- Dobivena je vrlo mala struja saturacije
- Faktor idealnosti je vrijednosti blizu 1 što pokazuje da u materijalu ne dolazi do tuneliranja i sličnih efekata
- Glavni uzrok transporta naboja je termička emisija
- DLTS mjerjenja pokazuju tri vrha koja označavaju duboke nivoe nastale zbog defekata
- Za potpuniju sliku potrebno je napraviti IV i CV analizu na većem rasponu temperatura

HVALA NA PAŽNJI!

Literatura

- [1] Brainkart.com; https://www.brainkart.com/article/Different-between-conductors,-semiconductors-and-insulators_265/
- [2] MDPI; <https://www.mdpi.com/2073-4352/12/2/245>
- [3] T. Brodar, *Karakterizacija električki aktivnih defekata u 4H-SiC metodama tranzijentne spektroskopije*, Doktorski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2020.
- [4] A. Hadžipašić, *Električni aktivni defekti u poluprovodnicima*, Završni rad rad, Prirodno-matematički fakultet, Tuzla, 2018.
- [5] T. Knežević, A. Hadžipašić, T. Ohshima, T. Makino, I. Capan, *M-center in low-energy electron irradiated 4H-SiC*, Applied Physics Letters (2022)
- [6] Md. Nuruzzaman, M. Ariful Islam, M. Ashraful Alam, M. A. Hadi Shah, A. M. M. Tanveer Karim, *Structural, elastic and electronic properties of 2Hand 4H-SiC*, Int. Journal of Engineering Research and Applications (2015)